

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: **85200054.6**

51 Int. Cl.⁴: **C 23 C 16/50**
C 23 C 14/34, G 01 L 1/22

22 Anmeldetag: **21.01.85**

30 Priorität: **30.01.84 DE 3403042**
28.01.84 DE 3402971

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
07.08.85 Patentblatt 85/32

88 Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts: **08.10.86**

84 Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB IT LU NL SE

71 Anmelder: **Philips Patentverwaltung GmbH**
Billstrasse 80
D-2000 Hamburg 28(DE)

84 Benannte Vertragsstaaten:
DE

71 Anmelder: **N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken**
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven(NL)

84 Benannte Vertragsstaaten:
BE FR GB IT LU NL SE

72 Erfinder: **Bringmann, Udo**
Schulstrasse 18
D-2083 Halstenbek(DE)

72 Erfinder: **Drews, Klaus**
Gärtnerstrasse 35
D-2083 Halstenbek(DE)

72 Erfinder: **Schön, Detlef Gerd, Dr.**
Ulmenweg 10
D-2083 Halstenbek(DE)

72 Erfinder: **Dössel, Olaf Helmut, Dr.**
Danziger Strasse 18
D-2086 Eilerau(DE)

72 Erfinder: **Gerstenberg, Klaus Wolfgang, Dr.**
Papemoorweg 2
D-2083 Halstenbek(DE)

72 Erfinder: **Kürsten, Gerhard**
Ostfaltenweg 16
D-2000 Hamburg 61(DE)

72 Erfinder: **Orlowski, Reiner Uwe, Dr.**
Rotdornweg 17
D-2085 Quickborn(DE)

74 Vertreter: **Nehmzow-David, Fritzi-Maria et al,**
Philips Patentverwaltung GmbH Billstrasse 80 Postfach
10 51 49
D-2000 Hamburg 28(DE)

54 **Vorrichtung zur Beschichtung eines Substrates mittels Plasma-CVD oder Kathodenzerstäubung, das damit ausgeführte Verfahren und Verwendung des Verfahrens zur Herstellung eines Dünnschichtsystems.**

57 Die Beschichtung eines Substrates mittels Plasma-Chemical Vapour Deposition oder Kathodenzerstäubung findet statt in einer evakuierbaren Kammer (1), in der eine in axialer Richtung feststehende erste Elektrode mit einer zentralen Bohrung (Ringelektrode) (5) und eine Gegenelektrode (Plattenelektrode) (3) zentrisch angeordnet sind, wobei die Ringelektrode auf einem zweigeteilten Isolatorblock angeordnet ist mit einem oberen, an die Ringelektrode angrenzenden, mit einer der zentralen Bohrung (11) der Ringelektrode entsprechenden zentralen Bohrung (13) versehenen ersten Teil (7) und mit einem, an den ersten Teil unmittelbar angrenzenden, auf der Bodenplatte (37) der evakuierbaren Kammer (1) über einem Anschlußstutzen (21)

der für die Evakuierung der Kammer erforderlichen Vakuumpumpe aufliegenden, den Anschlußstutzen freilassenden, zweiten Teil (9,99). Das mit dieser Vorrichtung ausgeführte Verfahren kann mit Vorteil verwendet werden zur Herstellung eines Dünnschicht-Dehnungsmeßstreifen-Systems bestehend aus einem elastisch verformbaren, flexiblen, metallischen Substrat, auf dem eine elektrisch isolierende Schicht aus einem plasmapolymersierten Material, insbesondere aus Si:N:O:C:H-haltigen Verbindungen, und auf dieser eine strukturierte Widerstandsschicht sowie eine elektrisch gut leitfähige Schicht mit einer Struktur für die elektrische Kontaktierung angebracht sind.

./...

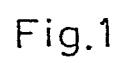


Fig.1



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0150878

Nummer der Anmeldung

EP 85 20 0054

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	FR-A-2 339 001 (WESTERN ELECTRIC) * Figure 1 *		C 23 C 16/50 C 23 C 14/34 G 01 L 1/22
A	--- PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Band 5, Nr. 109 (E-65)[781], 15. Juli 1981; & JP - A - 56 049 521 (YASUMITSU KAJIWARA) 06.05.1981		
A	--- US-A-3 748 253 (J.C. PROVENZANO) * Figur 1 *		
A	--- EP-A-0 068 636 (CONSARC ENGINEERING) * Zusammenfassung; Figur *		
A	--- PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Band 7, Nr. 13 (E-153)[1158], 19. Januar 1983; & JP - A - 57 172 741 (NIPPON DENSHIN DENWA KOSHA) 23.10.1982		
A	--- IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 26, Nr. 2, Juli 1983, Seite 588, New York, US; B.L. RATHBUN et al.: "Passivating coating"		
	--- -/-		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 24-06-1986	Prüfer DEVISME F.R.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	THIN SOLID FILMS, Band 55, Nr. 2, Dezember 1978, Seiten 253-259; J. TYCZKOWSKI et al.: "On the mechanism of electrical conduction in glow discharge polysilazane films"		
A	US-A-4 422 063 (R.W. PRYOR)		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 24-06-1986	Prüfer DEVISME F.R.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			